

## 所有機器一覧

汎用装置	専用装置	
赤外線吸収スペクトル分析装置 (FT-IR)	微量電量滴定装置 (硫黄, 塩素)	運送許容水分試験機 (TML)
紫外線可視光吸収スペクトル分析装置 (UV-VIS 分光光度計)	紫外蛍光微量硫黄分測定装置	紫外線照射機
蛍光分光スペクトル分析装置 (FL)	硫黄分測定器	カットウィンケル試験機
原子吸光度計 (AAS)	元素分析測定器 (CHNSO)	潤滑性磨耗試験 (HFRR, BOCLE)
ICP発光分光分析装置 (ICP-OES)	炭素/硫黄同時定量装置	鉛筆硬度計
波長分散型蛍光 X線分析装置 (XRF)	窒素/酸素同時定量装置	モース硬度計
X線回折装置 (XRD)	炭素/水素/窒素定量装置	自動熱量測定装置
走査電子顕微鏡-エネルギー分散型 X線分析装置 (SEM-EDX)	窒素分測定器 (微量電量滴定法, ケルダール法)	灰の自動溶融性試験装置
携帯型蛍光X線分析装置 (Niton)	塩素分測定器 (微量電量法, 酸水素炎燃焼-イオンクロマト法)	ハードグローブ粉碎性試験機
光学顕微鏡	硫化水素測定装置	るつぼ膨張指数試験装置
レーザー法粒度分布測定器	酸化還元電位測定器 (ORP)	酸素フラスコ燃焼装置
ガスクロマトグラフ装置	水分測定器 (KF 法, 蒸留法, 水素発生法)	乾燥機 (常圧, 減圧)
ガスクロマトグラフ質量分析計	密度測定器 (浮ひょう, ピクノメータ, 振動密度計, Harvard 法)	吸引濾過装置 (メンブランろ過)
誘導結合プラズマ質量分析計 (ICP-MS)	アニリン点試験機 (薄膜, U 字管, 試験管)	限外濾過装置
多次元ガスクロマトグラフ装置 (GC x GC)	融点測定器, 凝固点測定器	遠心分離装置・超遠心分離装置
蒸留ガスクロマトグラフ装置 (SIM-DIST-GC)	低温流動性測定器 (曇り点, 目詰まり点, 流動点)	粉碎機各種
オクタン価測定用ガスクロマトグラフ装置 (ON-GC)	析出点測定器	オスミウム蒸着装置 (SEM 観察用)
固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析計 (SPME-GCMS)	残留炭素試験機 (CCR, MCR, Ramsbottom)	恒温恒湿器
におい嗅ぎGC-MSMS装置 (異臭分析システム)	蒸留試験機 (常圧蒸留, 水蒸気蒸留, 減圧蒸留)	水蒸気蒸留試験機
PONA ガスクロマトグラフ装置	蒸気圧測定器 (リード法, 三回膨張法)	微生物培養試験装置各種
飛行時間型質量分析計 (GC-TOF/MS)	動粘度測定器	リアルタイム PCR 増幅装置 (遺伝子組換え)
同位体比質量分析計 (GC-IR/MS)	回転粘度計	マイクロウェーブ分解処理装置
熱分析-ガスクロマトグラフ質量分析計 (TG-MS)	振動粘度計	脱ベンタン蒸留装置
イオンクロマトグラフ装置 (IC)	銅板腐食試験機	透析装置 (ゴム膜, セルロース)
燃焼-イオンクロマトグラフ装置	銀板腐食試験機	ソックスレー抽出器
超臨界流体クロマトグラフ装置 (SFC)	色度計 (Pt-Co, Saybolt, ASTM)	試料調製装置各種
液体クロマトグラフ装置	実在ガム試験機	ビード作成及び高周波溶解装置
ゲルパーミエーションクロマトグラフ装置	酸化安定度試験機 (ポンペ法, 大型試験管法, ペトロオキシ法)	マイクロウェーブ分解装置
電気泳動分析装置	JFTOT 熱安定性試験	ポンプ燃焼装置
カラムクロマトグラフィー	MSEP 水分離指数	マイクロプレートリーダー
薄層クロマトグラフィー (TLC)	微粒きょう雑物試験機 (重量法, 粒度分布)	バイオセーフティ関連装置各種
キューリーポイントパイロライザー	導電率試験機	高圧蒸気滅菌器
屈折率計 (RI)	引火点測定器 (PMCC, TOC, TCC, TAG)	
旋光度計	発火点測定器	
液体シンチレーションカウンター	抽出セジメント測定器	
熱分析装置 (TG-DTA, DSC, TG-MS)	ワックス測定器	
自動滴定装置	アスファルテン測定器	
pH 計	FBT 試験機 (Filter block tendency)	
電気伝導度計	FIA 測定器 (PONA 分析)	
万能試験機	灰分融点試験機	